

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 4 区分
 【発行日】平成 25 年 3 月 7 日 (2013.3.7)

【公開番号】特開 2010-150579 (P2010-150579A)
 【公開日】平成 22 年 7 月 8 日 (2010.7.8)
 【年通号数】公開・登録公報 2010-027
 【出願番号】特願 2008-327696 (P2008-327696)
 【国際特許分類】

C 2 3 C 14/34 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 14/34 C

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 1 月 17 日 (2013.1.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ターゲットが取り付けられる回転自在な回転部材と、
 前記ターゲットと電氣的に接続され、前記回転部材の回転軸に沿った方向の前記回転部材の端部に配置された接続端子と、
回転軸方向に往復移動可能に構成され、前記接続端子を介して前記ターゲットに電力を供給する給電端子と、を有し、
前記給電端子を前記往復移動させることにより、前記給電端子を前記接続端子と接触または離間させ、前記給電端子と前記接続端子との導通または絶縁を切り替え可能なことを特徴とするスパッタリング装置。

【請求項 2】

前記給電端子と前記接続端子との少なくとも一方が、前記回転部材の回転方向に沿って延びている、請求項 1 に記載のスパッタリング装置。

【請求項 3】

前記回転部材は前記ターゲットを複数取り付け可能に構成されており、
 前記回転部材の前記端部には、前記ターゲットのそれぞれと接続される前記接続端子が配置されており、
 それぞれの前記接続端子は、前記回転部材の回転方向に並べられている、請求項 1 又は 2 に記載のスパッタリング装置。

【請求項 4】

前記回転部材の回転にともなって、前記給電端子と接続される前記接続端子が切り替わる、請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載のスパッタリング装置。

【請求項 5】

前記回転部材に取り付けられている前記ターゲットの表面に磁束を発生させるマグネットが、前記回転部材の内部に配されている、請求項 1 から 4 のいずれか 1 項に記載のスパッタリング装置。

【請求項 6】

前記回転部材が少なくとも 2 つ設置されている、請求項 1 から 5 のいずれか 1 項に記載のスパッタリング装置。

【請求項 7】

前記回転部材の、前記ターゲットが取り付けられる面に対向して配置され、処理を行う基体を保持するホルダーをさらに備える、請求項 1 から 6 のいずれか 1 項に記載のスパッタリング装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 2】

上記課題の少なくとも 1 つを解決するため、本発明に係るスパッタリング装置は、ターゲットが取り付けられる回転自在な回転部材と、前記ターゲットと電氣的に接続され、前記回転部材の回転軸に沿った方向の前記回転部材の端部に配置された接続端子と、回転軸方向に往復移動可能に構成され、前記接続端子を介して前記ターゲットに電力を供給する給電端子と、を有し、前記給電端子を前記往復移動させることにより、前記給電端子を前記接続端子と接触または離間させ、前記給電端子と前記接続端子との導通または絶縁を切り替え可能に構成される。